

Zepto (Low Cost / Low Budget)

Niederdruck Plasma Systeme

Low pressure plasma systems

for plasma cleaning, activation, etching and coating



Zepto (Low Cost / Low Budget)

Niederdruck Plasma Systeme
Low pressure plasma systems

Technische Daten

Gewicht

Ca. 15 kg (ohne Pumpe)

Vakuumkammern

Quarzglas (UHP) rund mit Deckel

Durchmesser 105 mm

Länge 200 mm oder 300 mm

Borosilikatglas (UHP) rund mit Deckel

Durchmesser 105 mm

Länge 200 mm oder 300 mm

W6

Durchmesser 160 mm

Länge 180 mm

Kammervolumen

Ca. 1,7 - 2,6 Liter

Gaszuführung

Nadelventile

Mass Flow Controller (MFCs)

Generator Frequenz

40 kHz Leistung 0 - 100 W

13,56 MHz Leistung 0 - 200 W

Elektroden

Ein Elektrodenpaar außerhalb der Vakuumkammer

Steuerung

Manuell

PCCE-Steuerung (Microsoft Windows CE)

PC-Steuerung (Microsoft Windows POS Ready 2009)

Drehschalter

Spannungsversorgung

230 V

Teilaufnahme

1x Warenträger

Druckmessung

Option Pirani

Technical data

Weight

Approx. 15 kg (33 lbs) (without pump)

Vacuum Chamber

Quartz glass (UHP) round with lid

Diameter 105 mm (4.1")

Length 200 mm (7.9") or 300 mm (11.8")

Borosilicate glass (UHP) round with lid

Diameter 105 mm (4.1")

Length 200 mm (7.9") or 300 mm (11.8")

W6

Diameter 160 mm (6.3")

Length 180 mm (7.1")

Chamber volume

Approx. 1.7 - 2.6 litres

Gas Connection

Needle valve

Mass Flow Controllers (MFCs)

Generator Frequency

40 kHz Power 0 - 100 W

13,56 MHz Power 0 - 200 W

Electrodes

RIE electrodes with gas shower

Control

Manual

PCCE-control (Microsoft Windows CE)

PC-control (Microsoft Windows POS Ready 2009)

Rotary switch control

Power supply

230 V

Partial recording

1x Product carrier

Pressure measurement

Option Pirani